

社団法人応用物理学会 集積化MEMS技術研究会

The study group of the integrated MEMS

集積化MEMS技術研究会
委員長 石田 誠
豊橋技術科学大学

-集積化MEMS技術研究会-

平成20年5月16日に応用物理学会にて承認を受け本研究会が設立いたしました。これまでに集積化MEMS技術研究会を開催し、多くの方の参加と活発な議論があり、本研究会への期待の大きさを感じました。HPも立ち上がっています。是非ご覧いただければと思います。

HPはこちらです → <http://annex.isap.or.jp/MEMS/>

-研究会設立主旨-

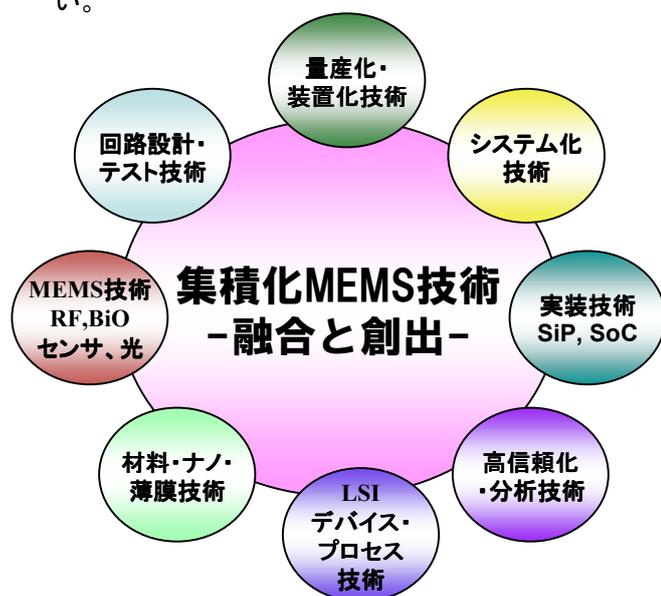
近年MEMSの市場は、予想以上の確実な伸びを示しています。その状況で、技術の方向性として集積化がキーワードとなっています。集積化の目的として、MEMSの集積化、CMOSLSIとの集積化などさまざまな提案がされています。特に、世界的潮流として、MEMS技術とLSI技術との融合は、重要な課題でありMore than Mooreの一つの解として期待され研究開発が活発化しています。

一方で、MEMS技術については、材料、プロセス、デバイス構造、実装技術、高歩留り技術、高信頼化技術等多くの課題が顕在化してきています。MEMS技術の創世期は、MEMS技術がLSI技術で培った半導体加工技術の導入により機械工学的な駆動部分や微細構造体を実現するというところで展開されて来ていますが、集積化とビジネス化に至りLSI技術のあらゆる分野の導入が不可欠になってきたと考えられます。まさに、機械工学と電気電子工学の新たな融合が必要になってきたと考えます。

このような背景において、LSI技術者が一同に会す応用物理学会の場に集積化MEMS技術研究会を設立しMEMSとLSI両技術分野の融合と新たなテーマに向けた研究活動の場を提供し国内の産業および学術に貢献したいと考えています。特に、MEMS技術における「これからの真の集積化」の推進をMEMS、LSIの観点から進め、学問的見地から実用化にいたるまで課題を見極め今後のMEMSの基盤構築を目指します。また、各学会との連携を図り、研究会を通じて広く人的ネットワークの裾野を広げ、産業界、大学含めた連携の基盤づくりを目指します。

-入会案内-

集積化MEMS技術研究会では、会員を募集しております。A会員(応物会員以外)、B会員(応物会員)の年会費は2,000円、一般賛助会員(法人)の年会費は20,000円、学生会員の年会費は無料となります(入会時期により会費は異なります)。会員の方へは企画等のご連絡を致します。会員のお申込は下記連絡先に電子メールでお申し込みください。



-申し込み方法-

★A会員、B会員、学生会員：氏名、所属、住所、電子メール、TEL/FAX、応物会員番号(B会員の場合)をご連絡ください。

★賛助会員：会社名、会社HP、参加代表者1名の所属、住所、電子メール、TEL/FAXをご連絡ください。尚、研究会への参加が3名までは可能です。参加代表者の方へ企画等のご連絡を申し上げます。

入会はこちら → masu.k.aa-memsjoin@m.titech.ac.jp

-お問い合わせ-

副委員長
益 一哉
東京工業大学統合研究院
Tel:045-924-5022
e-mail:masu@ieee.org